

# Bac De Décapage À Débordement En Ptfé De Haute Pureté Évier De Laboratoire De Nettoyage En Polytétrafluoroéthylène Sans Soudure Intégré

Numéro d'article: PL-CP32



## Introduction

Conception de bacs à débordement en PTFE de haute pureté avec construction intégrée sans soudure pour le décapage chimique agressif. Ces éviers durables sans soudure garantissent une étanchéité parfaite et une résistance chimique supérieure pour les applications exigeantes des laboratoires industriels et des semi-conducteurs.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage Clé
Gravure de Tranches de Semi-conducteurs	Bains d'acide de haute pureté pour éliminer les couches minces et les couches d'oxyde des tranches de silicium.	Zéro contamination par les métaux traces et contrôle précis de la concentration du bain.
Texturation des Cellules Solaires	Traitement chimique à grande échelle du silicium de qualité solaire pour améliorer les propriétés d'absorption de la lumière.	Résistance chimique aux agents de texturation agressifs et durabilité à long terme.
Décapage de Métaux de Précision	Élimination des impuretés de surface et du tartre des alliages spéciaux de qualité aéronautique et médicale.	Résiste aux mélanges d'acides concentrés sans dégradation structurelle.
Préparation pour l'Analyse de Traces	Nettoyage de la verrerie de laboratoire et des capteurs dans un environnement d'acide de haute pureté à écoulement constant.	Bruit de fond ultra-faible et prévention de l'adsorption des analytes.
Nettoyage Pharmaceutique	Stérilisation et nettoyage de composants de haute pureté à l'aide d'agents de désinfection agressifs.	Les surfaces lisses et non poreuses empêchent la croissance bactérienne et la rétention chimique.
Recherche sur les Batteries	Test des matériaux d'électrode dans des électrolytes corrosifs pour le développement de batteries lithium-ion et à flux.	Isolation chimique complète et prévention des fuites induites par l'électrolyte.
Bains de Galvanoplastie	Fourniture d'un récipient stable et non réactif pour les processus spéciaux de placage à l'or ou au platine.	Élimine les interférences électrochimiques des matériaux de la cuve.
Stockage Chimique	Contenant à long terme pour réactifs ultra-purs nécessitant un contact nul avec les surfaces métalliques ou en verre.	Préservation du grade réactif sur de longues périodes de stockage.

Fonctionnalité	Détails des Spécifications (Modèle : PL-CP32)
Matériau de Base	100% PTFE Vierge de Haute Pureté (Polytétrafluoroéthylène)
Méthode de Fabrication	Usinage CNC Intégré d'une Pièce (Sans Soudure/Sans Joint)
Plage de Température de Fonctionnement	-200°C à +260°C (-328°F à +500°F)
Résistance Chimique	Résistance universelle (sauf aux métaux alcalins fondus et au fluor élémentaire)
Type de Conception	Système de Débordement Intégré Interne/Externe
Épaisseur de Paroi	Standard de 10mm à 30mm (Entièrement Personnalisable)
Finition de Surface	Finition lisse de haute précision (Ra < 0,8 µm disponible)

Application	Description	Avantage Clé
<b>Fonctionnalité</b>	<b>Détails des Spécifications (Modèle : PL-CP32)</b>	
<b>Capacité Dimensionnelle</b>	Construction sur mesure, des petites échelles de laboratoire aux grands volumes industriels	
<b>Configurations des Orifices</b>	Ports filetés PFA/PTFE optionnels, connexions à bride ou déversoirs de débordement	
<b>Certification</b>	Conformité de sécurité et de pureté des matériaux pour une utilisation en salle blanche	
<b>Options de Personnalisation</b>	Dimensions, épaisseur de paroi, conception du couvercle, déflecteurs internes et supports de capteurs	